



S10

HIGH VACUUM ION SPUTTER COATER

高真空离子溅射仪

The S10 is a high-vacuum ion sputter coater based on magnetron sputtering technology. It integrates a turbo molecular pump and an oil-free diaphragm pump to provide an ultra-clean high-vacuum environment ($<5 \times 10^{-2}$ Pa). Featuring a coordinated design of tilted target and rotary sample stage, it deposits uniform and stable conductive coatings on sample surfaces. The system is widely suitable for (ultra-)high-resolution FE-SEM sample preparation, particularly for 3D powder samples and delicate specimens. Available sputtering targets include Au, Pt, Pd, Ir, and other materials.

S10是一款基于磁控溅射原理的高真空离子溅射仪，采用内置涡轮分子泵与无油隔膜泵联用，可提供洁净的高真空环境（ $<5 \times 10^{-2}$ Pa）。结合倾斜靶与旋转样品台的协同设计，可在样品表面形成均匀、稳定的导电镀层，广泛适用于超高分辨场发射电镜样品和FIB样品的导电镀层制备。可溅射金属：Au、Pt、Pd、Ir、W等。

触摸屏控制，即插即用。



倾斜靶+旋转台设计

对3D类样品友好

无油高真空泵组

清洁无污染

紧凑一体机

超快启停

SuPro Instruments Limited

速普仪器

Nanshan,

Shenzhen, China

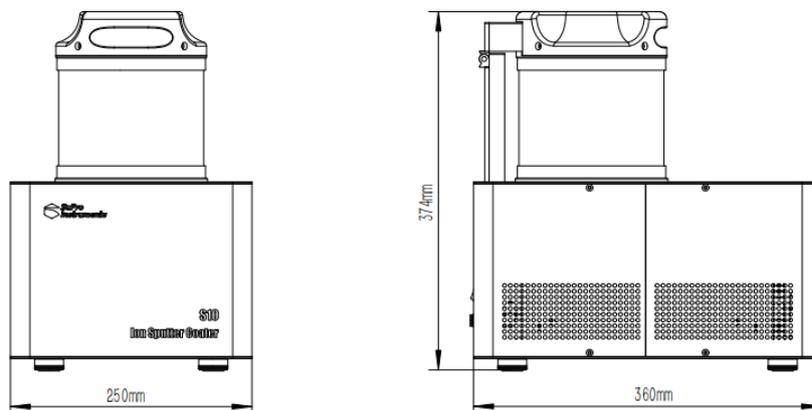
www.suproinst.com

Tel: 86-755-26642901

Fax: 86-755-26419205

Email: sales@suproinst.com

技术规格	参数
适用场景	超高分辨场发射扫描电镜 (FE-SEM) 样品和FIB样品表面导电镀层制备
真空泵组	涡轮分子泵+无油隔膜泵
抽速	分子泵: ≥ 9 L/s; 隔膜泵: ≥ 0.7 m ³ /h
极限真空	$< 5 \times 10^{-2}$ Pa
工作气压	0.5-1.5 Pa
气体控制	MFC气体质量流量控制器 (≥ 5 SCCM N ₂)
泵组启动时间	<5 min
溅射计时	0-300 s
真空计	复合高真空计 (测量范围: 1×10^{-3} Pa-标准大气压)
腔体 (标配)	石英玻璃腔体 (外尺寸 $\varnothing 150$ mm \times H 120 mm)
旋转样品台	直径: $\varnothing 80$ mm; 转速: 60 RPM; 工作距离: 55-70 mm (连续可调)
溅射靶材	$\varnothing 30$ mm, 厚度 (0.2-1) mm
溅射电源	恒功率直流磁控溅射电源, 输出: 1-20 W; 0-100 mA; 0-800 V
进气口	$\varnothing 6$ mm气路接口
操作方式	触摸屏控制, 控制系统提供互锁保护功能
重量	~17 kg
尺寸	250 mm宽 \times 360 mm深 \times 374 mm高
输入电源	100-240 V AC, 50/60 Hz, 三脚接地插头
功耗	<160 W
质保	一年
备注	以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知, 如有疑问请联系我们



深圳市速普仪器有限公司
 地址: 深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009
 电话: 0755-26642901 传真: 0755-26419205
 邮件: sales@suproinst.com
 www.suproinst.com

速普仪器 (太仓) 有限公司
 地址: 苏州市太仓健雄路大学科技园11号楼1003
 邮件: zkchang@suproinst.com
深圳市速普仪器有限公司 (北京办)
 地址: 北京市房山区怡和北路5号院熙悦汇4号楼307室